(54) COPPER ALLOY FOR CONMECTING WIRE

(11) 55-41939 (A) (43) 1980 (19) JP

(21) Appl. No. 53-114478 (22) 2.1978

(71) FURUKAWA DENKI KOGYO K.K.(1) (72) SADAO INOUE(3)

(51) Int. Cl<sup>3</sup>. C22C9/00

PURPOSE: To provide a copper alloy which is used for connecting wires and is excellent in connecting characteristics, by mixing Cu with specific quantities of Fe and P.

CONSTITUTION: A copper alloy containing by weight, 0.5~3.0% Fe, 0.2~0.5% P generates no heat at the connecting section, hardly produces minute discharge, and is small in the proliferation of cuprous oxide at a lowered contact press. and under an incomplete contact condition, so that the alloy is excellent as a material for connecting wires.

#### (54) ION SULPHURIZING AND NITRIDING METHOD

(11) 55-41940 (A) (43) 25.3.1980 (19) JP

(21) Appl. No. 53-114510 (22) 20.9.1978

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) YOSHIYUKI KOJIMA(2)

(51) Int. Cl3. C23C11/14,C23C11/00

PURPOSE: To form the sulphurized and nitrided layer of superior abrasion resistance and self-lubricity on steel plate surfaces by the nitriding the sulphurizing method by glow discharging in the mixed gases of NH<sub>3</sub> and H<sub>2</sub>S or the mixed gases of at least one kind of H<sub>2</sub>, Ar, He and NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S with the iron or steel material as cathode.

constitution: The iron or steel member to be treated is put in an evacuated vessel to make a vacuum in the vessel, after which hydrogen gas is introduced therein and the material to be treated is raised of temperature to 400~600°C by glow discharging. Next, the gas is substituted with the mixed gases of 95 up to 100% of NH<sub>3</sub> and 0.01 to 5% of H<sub>2</sub>S or the mixed gases of 25~100% of NH<sub>3</sub>, 0.01~5% of H<sub>2</sub>S and the rest of at least one of Ar, H<sub>2</sub>, He. With the member to be treated as cathode, the glow discharge is continued in the gases containing NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S to let nitriding and sulphurizing the simultaneously effected through ion sulphurizing and nitriding. The sulphurized and nitrided layer of superior abrasion resistance and self-lubricity is formed.

# (54) IRON BASE MEMBER OF SUPERIOR ABRASION RESISTANCE AND PRODUCTION THEREOF

(11) 55-41941 (A) (43) 25.3.1980 (19) JP

(21) Appl. No. 53-114511 (22) 20.9.1978

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KAZUYOSHI TERAKADO(4)

(51) Int. Cl3. C23C11/00,C23C11/14

PURPOSE: To improve abrasion resistance and self-lubricity by forming an ion carburized and nitrided layer on the surfaces of carbon steel or low alloy steel which does not contain any element having strong affinity to N<sub>2</sub> then further forming any of an ion sulphurized and carburized layer, ion sulphurized and nitrided layer

and ion sulphurized, carburized and nitrided layer.

CONSTITUTION: A member of carbon steel or low alloy steel which does not contain any element having high affinity to N<sub>2</sub>, such as Cr, V, Al, Si Mo or other is put in a vessle. The mixed gases of the least one of H<sub>2</sub>, Ar, He as a diluting gas and methane base hydrocarbon gas and N<sub>2</sub> gas as C source are sealed in the vessel to about 1~10torr, thence with the steel material to be treated as cathode, voltage of 300~1500V is applied between the same and anode to allow glow discharge to occur. An ion carburized and nitrided layer is formed on the steel material surface and further one of an ion sulphurized and carburized layer, ion sulphurized and nitrided layer and ion sulphruized, carburized and nitrided layer is formed thereon through the similar glow discharge. The diluted gas of H<sub>2</sub>S gas is used as the gas for sulphurizing.

# (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭55-41940

(1) Int. Cl.<sup>3</sup>C 23 C 11/14C 11/00

識別記号

庁内整理番号 6737-4K 6737-4K **43公開 昭和55年(1980)3月25日** 

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

## 60イオン浸硫窒化法

@特

❷出

願 昭53-114510

顧 昭53(1978)9月20日

@発 明 者 児島慶享

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

**炒発明者朝日直達** 

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

@発明者山口静

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内:

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内 1 丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 高橋明夫

#### 明 細 智

発明の名称 イオン浸硫窒化法

#### 特許請求の範囲

- 1. 低圧容器内で被処理材化グロー放電させて表 面処理する方法において、NH。とH。Sの混合ガ ス中でグロー放電を発生させて処理することを 特徴とするイオン愛硫镍化法。
- 2. 低圧容器内で被処理材にグロー放電させて表面処理する方法において、H, Ar, He の少なくとも1つと、NH。およびH, S, の混合ガス中でグロー放電させるくとを特徴とするイオン
  浸硫酸化法。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、NH, ガス 量が95~100体積も未満であるイオン侵債 窒化法。
- 4. 特許請求の範囲第1項又は第2項において H<sub>2</sub>Sの量が0.01~5体積まであるイオン受強 強化法。
- 特許請求の範囲第2項においてNH。ガス量が
   25~100体積も未満であるイオン浸硫強化

法。

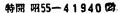
6. 特許請求の範囲第2項又は第5項において、 H<sub>1</sub>8が0.01~5体積%であるイオン浸硫盤 化法。

#### 発明の詳細な説明

本発明はイオン浸硫盤化法に係り、特に鉄鋼材料の被処理物に適用するのに好適な表面処理法に関する。被処理物の表面に耐摩耗性と自己潤滑性を付与する手段として、健化と浸硫を同時に施す方法がある。これの代表的なものがスルースルフ法(Sur-Sulf法)である。この方法は塩や中に被処理物を装入するものであり被処理物へ付着した塩谷の除去用排液の廃棄処理に問題を残す。又、上記した点の他に、この方法は処理条件の設定が難しく、処理層のNとSの機度の制御もしにくいという欠点がある。

他方、塩浴を用いた表面処理法の欠点を解決するものとして、最近、イオン工学的処理法が注目 されている。しかし、技術的な成功をみているの はイオン盤化法だけで、イオン浸蔵は成功してい

(2)



ない。イオン侵硫镍化に至つては、その報告すら 殆んどなされていない。

本発明の目的は、被処理物の表面にイオン工学 的処理によつて選化と及硫を同時に施す方法を提供するにある。

本発明は、排気している容器中にガスを導入し、 被処理物を陰極として陽極との間で直流電圧を印 加するイオン表面処理法において、上記ガスを NH。とH。S あるいはA r とHe とH。の少なく とも1つとNH。およびH。S との混合ガスとした ものである。

本発明の表面処理法は、金属材料の被処理物に 対してきわめて良好な効果を発揮する。

本発明において、ガス中のNH。の量はNH。
ーH。SRまでは90~100体積を未満が適当であり、残りがH。Sとなる。H。Sの最はなるべく001体積をを下回らないようにした方がよい。なお、体積をを以下では単にもとして表わす。

処理の温度は400~600℃の範囲が適当である。



(3)

物に対しても、予備処理を超すことなくイオン選 化を施すことができる。

しかし、反面、電化層は変形態が小さく、又、 自己潤滑性も全く付与されないものになる。 した がつて、 これを掲動摩耗部品として用いた場合に は、 初期なじみが悪く、焼き付き、かじりが生じ ることは難けられない。

上記のことから、次にイオン浸硫について検討した。一般に発表されているイオン浸硫はSの供給ガスとしてH、Sを用い、格釈ガスとしてH、。 Ar Hcの少なくとも1つを用いる。そこで、 上記ガスを10<sup>-1</sup> Torr以下に排気した真空室中 へ導入し、グロー放電を形成してイオン浸硫を行なつた。

実験の結果、イオン浸硫ではH。Sの量によつて表面層の形態が変わり、H。S量が5を以上の場合には表面層が処理後に別離することがわかつた。X線回折したところ別離後の被処理物の表面にはS又はS化合物の存在が認められながつた。又、摩耗試験では未処理材と顕著な有意差がなか



**(5)** 

上記したガスの組成ならびに処理温度の条件を 満たせば、多くの場合に3~50 μmの厚さの処理 理層が得られる。この厚さは被処理物の表面に耐 摩託性と自己潤滑性を与えるために、厚すぎもせ す又薄すぎもしない好適なものである。

なお、ガスを導入する前の真空度は Q.1 Torr 以下にするのが望ましい。

又、ガス導入後の真空度は 1 ~ 5 Torr にする のが望ましい。

以下、本発明がなされるに至つた経過を順を追 つて説明する。

まず、従来のイオン窗化法について効果を確認した。イオン窗化法は、 望素の活性化手段としてクロー放電中のブラズマを用いるため、他の活性化処理を要しない。又、処理時間が短いだけでなく、 放圧下の雰囲気中で処理するためにガスの使用量も大幅に波らすことができる。処理中にスパッタリング作用が継続して行なわれ、これにより被処理物の装面のスケール落としがなされるので、表面に酸化物層が生成しやすい金属材料の被処理

(4)

つた。他方、 H. S 量が5 まよりも低い場合には 第1図に示した処理後の被処理物の400倍の断 面写真から明らかなように、S および S 化合物は 極めて少ない。 X 顧回折では優量の S 化合物の存 在が確認されたが、付着力の弱い脆弱層が形成さ れたにすぎなかつた。

以上のことから、従来のイオン盤化は摺動摩耗 部品に対して適用するには不適当な場合もあり、 又、イオン浸硫は技術的に未完成であるので、採 用するには至らないとの結論に達した。

そとで、新しいイオン工学的処理法を研究する ととにし、具体的には盥化と浸硫を同時に行なつ た方が有用性があるととから、それについて研究 を始めた。

浸硫窒化によつて耐摩耗性と自己潤滑性を高度 に具えさせるには、強化層中に塑性飛動しやすい 稠密六方晶を形成させ、さらに像細孔を設ける必 要がある。

前述した本発明の処理法は、上記した状態を再 現性をもつて作り出すことができる。 浸硫窒化層

1

(6)

特別 昭55-41940 (3)

の状態は、従来の塩浴を用いたときと類似しているが、本発明は無公害であるとどからすれば、そ の効果には甚大な開きがある。

イオン浸硫盤化によつて、被処理物の表面に耐 摩耗性が良く、自己潤滑性がある層を作るには、 ガスの穂類およびその組成がきわめて重要な条件 になる。NH、とH、Sの混合ガスあるいは、 NH、とH、Sを含み、炎りがArとHeとH。 の少なくとも1つからなるものでなければ、満足 のいく後硫蜜化磨は得られない。NH』の組成は NH, -H, S系ではNH, が95~100名未 満(体積も)であり、NH。-H。S-X ガス系 では、NH, は25%以上100%未満が望まし く、特に50も以上100も未満が超ましい。 NH。量がこの値より低いとSが固体状に凝集析 出して成長し、これがその後のSの内部への拡散 を岨害するとともに、処理後の冷却中に凝集析出 物が剝離して表面処理の効果を失わせることがあ る。NH、量の増大に伴つてSおよびNの内部へ の拡散が進む。

(7)

第3図では綾軸に摩耗被量をとり、横軸にH。S の組成をとつせ。S化合物を自己潤滑に寄与させ て摩耗被量を低下させるには上記した範囲のH。S 組成とすべきであり、特に0.1~4 5 が最も選ま しいことが明らかである。

NH、一H、S系のガスではNH、が分解してH。系ガスを発生し、これが表面のスパッタークリーニング作用をする。一方NH、一H。SーX系ガスでのAr。HeをおよびH。の少なくとも1系ガスでのAr。HeをおよびH。の少なくとも1公害であるので排ガスの処理に困難を要するとはない。なお、H。Sは有害であるが、真空中で始んど希釈されてしまうので、特に問題は生じない。希釈ガスはグロー放電ブラズマ中でイオン化され、被処理物である陰極にスパッタークリーニングをうけ清浄面に保たれる。

希釈ガスとしてのAr, He, H, のうちでは H, が最も望ましく、又、希釈ガスの量は50% 以下が特に望ましい。

(9)

第2図はNH。と0.3 のH。SとH。からなるガス中でクロムモリプデン鋼材SCM21を被処理物として、550℃、2時間の処理を行なつたときの被処理物表面の化合物層厚さとNH。組成との関係を示している。この図からNH。組成の影響が明らかである。

NH、分解ガスを除く残りのガスのうちH、8 は被処理物の表面へS化合物を形成させる役割を有する。H。Sの量が5ををこえると処理後の冷却時にS化合物の剝離や脱落が生じやすくなるので、H、Sの量は5ををこえないことが望ましい。一方、H。Sの量は少なすぎても駄目で、なるべく0.01を以上含ませるべきである。第3図はNH。とH。Sとからなるガス中でクロムモリブデン鋼材SCM21を被処理物として、550で、2時間の処理を施したものについて大越式降の条件は、相手材SUJー2(硬度Rc60以上)、荷重126kg、摩擦速度291m/s、摩擦距離200m、獨覆油はタービン油・120である。

(8)

被処理物は金属材料であれば処理が可能である。 特に鉄鋼材料ではN化合物、S化合物が形成され やすく、又、それらが耐摩耗性に有効に働く。

本発明の処理法は次のようにして行なわれる。

NH。分解ガスとH。 Sと希釈ガスとの混合ガ スを10<sup>-1</sup> Torr以下に排気された真空室中へ導 入する。真空室中には陰極となる被処理物と陽極 (なくの場合炉壁とする)とを備えておく。陽極 と陰極との間に電圧を印加し、グロー放電を形成 する。真空室中の上記混合ガスはグロー放電プラ メマによりイオン化され、Nと8が分解してでき 処理物表面で反応しN化合物及びS化合物を形成 する。Nは化合物を形成すると同時に被処理物中 に拡散浸透し装面化合物属の下部の硬度を上昇さ せる。グロー放電の継続により、処理中、上記の 反応及び拡散浸透は連続的に行なわれ有効な量の 処理層が形成される。なお、処理温度は入力電源 の調節により処理中段は一定に保持する。本発明 の方法において浸硫層と強化層の両者を有効に形 成する為には400~600℃の温度範囲が適当

12

-167-

<del>(</del>10)

特閱 昭55-41940(4)

る。しかも、本発明によれば、イオン筺化と同一 のNH。分解ガス組成による処理でもH。Sの係 加により表面化合物層の厚さをイオン蜜化の場合 の数倍にすることができる。つまり、本発明はイ オン選化で問題があつたβ相を摩耗に対して有効 に作用する層にできるばかりでなく、その層自体 の厚さも厚くすることができる。

したがつて、初期なじみ、焼き付き、かじりと いう問題に関して大幅な向上をはかることができ . る。又、本発明においても、イオン盤化と同様に Nの内部への拡散浸透は行なわれており、硬化階 の架さ及び硬さは従来のイオン窒化と同様のもの と かる。

他方、従来のイオン長硫法は、被処理物表面に 有効な化合物層を形成することができない。本発 明によれば、S化合物の形成がドモーS系から Fe-S-N系になつている為、より安定なS化 合物が得られる。つまり、従来のイオン浸硫では 被処理物表面にS化合物が析出するのみであり、 その化合物と被処理物の結合力が弱い為、グロー

> (12) 18

一放電を形成した。グロー放電を継続しながら被 処理物態度を上昇させ、更にその間スパツタリン グにより被処理物表面をスパッタークリーニング し清浄化した。被処理物温度が550℃に達し、 表面清浄化が十分なされた後、導入ガスをH。か らNH。分解ガスH。Sで構成される混合ガスに 切り変えた。真空度は3Torrに維持した。なお 混合ガス組成はH28が0.5%、残部NH3分解 ガスである。混合ガス導入後、550℃の温度に 保持して2時間処理を行なつた。上記条件の処理 によつて得られた被処理物の断面組織を400倍 に拡大して第4図に示す。たむ、第1図のSCM 21に従来のイオン投硫を施した一例では化合物 層は全く形成されていなかつたのに比べ、本発明 による処理層は第4図から明らかたように表面化 合物量が約15μmの厚さで形成された。更に、 上記被処理物のX線回折結果は第5回に示したよ うであり、表面化合物層にはN化合物とS化合物 が存在することが確認された。つまり、第4図の 表面化合物層はN化合物中にS化合物が均一に分

である。400℃以下ではN化合物の拡散が遅い し、又、内部拡散も十分に進まない。一方、600 で以上では熱変形の心配がでてくる。

本発明は塩浴を用いた浸硫窒化法にくらべて無 公寓であるというまわめて大きい効果を有するが、 イオン窒化、イオン養硫にくらべても以下の点で すぐれている。

イオン強化ではN化合物層及びNの拡散浸透に よる硬化層しか得られず、その処理層には自己圏 滑性が全く無い。本発明によればN化合物中にS 化合物が均一に分散した処理層が得られ、との層 はN化合物のみの層に比べ変形能に食みかつ自己 閥滑性を有したものとなる。

したがつて、イオン硫化に比べ、初期なじみが 向上し、焼き付き、かじり等が防止できる。又、 イオン盤化で最表面に形成される化合物層である ■一相は変形抵抗が少ない脆い層であり、耐摩耗 性の点からはむしろ問題の層であつたが、本発明 ではεー相とS化合物とを混在させることにより、 その化合物層を耐摩耗性化対し有効に利用してい



(11)

放電によるスパッタリング作用により処理中にS 化合物は被処理物表面からはじき飛ばされる可能 性が強かつた。本発明ではS化合物はFe-S-N系の反応で形成される為、S化合物はN化合物 中に安定して分散析出するととになり、スパッタ リング作用によりはじき飛ばされる可能性が少な くなる。その結果、従来のイオン浸硫では形成因 難であつたS化合物を本発明では容易に形成する ととができる。更に、このようにして形成された S化合物は自己潤滑性を有しており、摩耗に対し て初期なじみ、焼き付き、かじり等の問題の改善 に大いに役立つ。

以下に本発明の実施例を説明する。

#### 実施例1

被処理物として冷間圧延續板SPCを用いて本 発明の処理法を実施した。先才、被処理物を陰極 とし、真空炉体を陽極とし、予め10<sup>±2</sup> Torr以 下に排気した真空室中にH。ガスを導入した。導 入ガス流量を調節し、真空室中を3 Torrになる ように調整した後、両極間に高電圧を印加しグロ

(13)

散して形成されているものであつた。 実施例2

被処理物としてクロムモリブデン鋼材SCM 21を用いて、実施例1と同一条件にて処理を行なつた。処理後の断面組織及び表面のX線回折結果は実施例1のSPCと同様であり、得られた表面化合物層もN化合物中にS化合物が均一に分散したものであつた。

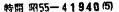
上記の本発明による処理材と100 f NH。分解ガス550で、2時間のイオン選化を施したSCM21の摩耗試験の比較を集6図に示す。第6図は大越式摩耗試験の結果である。試験条件は、相手材SUJ-2(Rc60以上)、摩耗距離200m、稠滑油はタービン油+120であり、荷重は126%かよび189%とした。図中1と2は本発明、3と4はイオン選化である。又、1と3は荷重18.9%、2と4は126%である。第6図から明らかなよりに、本発明による処理は従来、耐摩耗処理として用いられていたイオン選化法に比べ、その耐摩耗性は大幅に向上していた。



(15)

示したものについて長硫窒化層のX線回折結果を 示したグラフおよび第6図は大越式摩耗試験結果 で摩耗被量と摩耗速度の関係を示す特性図である。 1,2…本発明。

代理人 弁理士 高橋明表



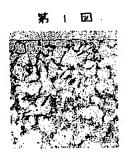
なお、実施例I及び2では混合ガスとしてNH。 分解ガスH。Sを用いたが希釈ガスとしてH。。 Ar、He又はArとHeとH。の二種以上のガスを用いても上配実施例と同様の処理が可能であった。又、得られた処理暦も実施例2と同様の耐摩耗性を有していた。

以上のように、本発明によればイオン工学的処理法によつて、被処理物の表面に受硫強化層を形成することができる。又、その浸硫酸化層は従来の塩俗を用いた場合と同程度のものになる。したがつて、公客問題のある上記従来の方法に置き換えるものとして適当している。

## 図面の簡単な説明

第1図は従来のイオン侵硫法の一実施例を示す 断面写真、第2図は本発明の一実施例で浸硫酸化 層の厚さとNH、分解ガス量との関係を示す特性 図、第3図は本発明の他の実施例によって得られ たものについての摩耗試験結果で、摩耗減量と H、S量との関係を示す特性図、第4図は本発明 の他の実施例を示す断面写真、第5図は第4図に

(16)



(X 400 )

第 2 回

